

NEW MULTI-FUNCTIONAL MICRO- AND NANOIMPRINT SOLUTION FROM EV GROUP OFFERS UNPRECEDENTED FLEXIBILITY FOR HIGH-VOLUME OPTICAL DEVICE MANUFACTURING – January 19, 2022

EV Group (EVG), a leading supplier of wafer bonding and lithography equipment for the MEMS, nanotechnology and semiconductor markets, today introduced the EVG®7300 automated SmartNIL® nanoimprint and wafer-level optics system. The EVG7300 is the company’s most advanced solution to combine multiple UV-based process capabilities, such as nanoimprint lithography (NIL), lens molding and lens stacking (UV bonding), in a single platform. This industry-ready, multi-functional system is designed to serve advanced R&D and production needs for a wide range of emerging applications involving micro- and nano-patterning as well as functional layer stacking.

EV集团新型多功能微米压印解决方案为大批量光学设备制造赋予前所未有的灵活性

2022年01月19日 10:50:14 作者: 本站

EVG®7300是EV集团最先进的解决方案，能够在单个平台中结合多种紫外线工艺，包括纳米压印光刻（NIL）、透镜成型和透镜堆叠（UV键合）

2022年1月19日，奥地利圣弗洛里安 - 微机电系统（MEMS）、纳米技术和半导体市场晶圆键合与光刻设备领先供应商EV集团（EVG）现推出EVG®7300自动化SmartNIL®纳米压印与晶圆级光学系统。EVG7300是EV集团最先进的解决方案，在单个平台中结合了多种紫外线工艺技术，包括纳米压印光刻（NIL）、镜片成型和镜片堆叠（紫外线键合）。这部面向行业的多功能系统旨在满足多种新兴应用的研发和生产需求。这些新兴应用大多涉及微米和纳米图案成型以及功能层堆叠技术，包括晶圆级光学系统（WLO）、光学传感器和投影仪、汽车照明、增强现实耳机波导、生物医学设备、超透镜和超表面，以及光子学应用。EVG7300支持最大300毫米晶圆尺寸，具有高精度调准、先进工艺控制和高吞吐量等优势，可满足多种自由曲面和高精度纳米和微光学元件与器件的大批量制造需求。

EVG®7300自动化SmartNIL®纳米压印与晶圆级光学系统在单个平台中结合了多种紫外线工艺技术，是最先进的多功能解决方案。

EV集团企业技术总监托马斯·格林斯纳（Thomas Glinsner）表示：“EV集团深耕纳米压印技术领域二十余载，我们将继续在这一重要领域开拓创新，开发出新型解决方案，满足不断变化的客户需求。EVG7300是EV集团纳米压印解决方案系列的最新成员，将我们的SmartNIL全场压印技术与透镜成型和透镜堆叠技术结合于顶级系统，拥有市场上最精确的调准和工艺参数控制功能，为我们的客户带来了前所未有的灵活性，足以满足行业研究和生产需求。”

推荐文章

- 1 阿诺达斯Techfit RECOVERY系列...

图片推荐

源于“体质研究”的 科技赋能物业管理

TCL入选2021福布斯 AOC游戏鼠标GM500全

热门文章排行

- 1 一推箱惊艳一推城！「东方百美园」七日
- 2 携手奋进新时代 同心共筑中国梦
- 3 正保远程教育：在线教育走得远，内容和
- 4 大洋科考的忠实记录者——佳能EOS
- 5 人工智能+物联网=?
- 6 全民扫花识草进行时 QQ浏览器携手野
- 7 向阳打造中秋“寻宝”活动工具，为企业
- 8 强劲主机 Xbox One X 全球上市
- 9 创想科技闪亮GMIC大会 推动区块链场景
- 10 浅谈众签“电子合同+”在《电子商务

南方基金 目标财富

牛得起 守得住

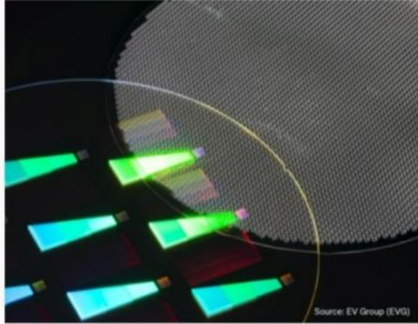
看涨 观望

买南方中证500 买南方理财金H

500ETF: 510500 交易代码: 511810

南方500: 160119 申购代码: 511811

EVG7300系统既可作为独立工具，也可用作EV集团HERCULES® NIL全面集成UV-NIL跟踪解决方案中的集成模块。UV-NIL解决方案可添加额外的预处理步骤，例如清洁流程、抗蚀剂涂层、烘焙或后处理等，以满足特定工艺的优化需求。EVG7300系统结合了调准平台改进、高精度光学、多点间隙控制、非接触式间隙测量和多点力控制等技术，达到了业内领先的调准精度（最低可至300纳米）。EVG7300是一种高度灵活的平台，提供三种工艺模式（透镜成型、透镜堆叠和SmartNIL纳米压印），支持从150毫米到300毫米晶圆的基板尺寸。该高效平台能够快速加载印版和晶圆、快速调准光学器件、提供高功率固化功能，且工具尺寸小巧，能够充分满足行业对新型晶圆级光学系统（WLO）产品的制造需求。



SmartNIL®配备了增强现实波导和晶圆级透镜头压印功能，使新的EVG®7300系统拥有广泛的应用场景

产品上市信息

EV集团现已开始接受该系统的订单，同时，可在EV集团总部的NILPhotonics®技术中心观看产品演示。

关于 EV 集团(EVG)

EV集团 (EVG) 是为半导体、机电系统 (MEMS)、化合物半导体、功率器件和纳米技术器件制造提供设备与工艺解决方案的领先供应商。主要产品包括：晶圆键合、薄晶圆处理、光刻/光刻纳米压印 (NIL) 与计量设备，以及光刻胶涂布机、清洗机 and 检测系统。EV集团成立于1980年，可为全球各地的客户和合作伙伴网络提供服务与支持。

<http://www.diyikj.cn/kpiy/2022/10487801.html>